## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 29. März 2001 (29.03.2001)

**PCT** 

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/22477 A1

(51) Internationale Patentklassifikation?:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/09177

H01L 21/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. September 2000 (20.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 45 648.8 23. September 1999 (23.09.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): STEAG HAMATECH AG [DE/DE]; Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 10, 75447 Sternenfels (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WEBER, Klaus [DE/DE]; Friedenstrasse 58, 75015 Bretten (DE). SĀ-MANN, Martin [DE/DE]; Altheckenstrasse 8, 75443 Otisheim (DE). KALLIS, Jürgen [DE/DE]; Hindenburgstrasse 49/1, 75417 Mühlacker (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, IL, JP, KR, SG,
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

## Veröffentlicht:

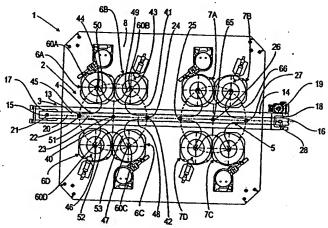
Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen eintreffen.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR LOADING AND UNLOADING SUBSTRATES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM BE- UND ENTLADEN VON SUBSTRATEN



(57) Abstract: The invention relates to a device (1; la; lb) for loading and unloading of substrates using a conveyor device (83; 3a; 3b) which is used to convey a substrate in a linear manner comprising at least one handling facility which can be rotated (4, 5; 4a) and which is intended for the transport of said substrate between said conveyor device (3; 3a; 3b) and at least one process station (6A to D, 7A to D; 80A to H) wherein a small number of components are used and a small amount of space is taken up when the conveyor device (3; 3a; 3b) is arranged between at least two process stations (6A to D, 7A to D; 80A to H) and the at least one handling facility

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]